

KEK クライオ電子顕微鏡 (Talos Arctica, Falcon 3EC)

外部向け初期トレーニング・テキスト

本テキストは、以下の先生方のご協力のもと、作成いたしました。心より感謝申し上げます。(*敬称略)

青山一弘 [FEI/阪大]、八木橋陽 [FEI]、Robert Stickler [FEI]、千田俊哉 [KEK]、川崎政人 [KEK]、湯本史明 [KEK]、Christoph Gerle [阪大]、岩崎憲治 [筑波大]、杉田征彦 [阪大]、横山武司 [理研]、内窪友美 [理研]、Arjen J. Jakobi [TU Delft]、Radostin Danev [東大]、包明久 [東大]、滝沢由政 [東大]、重松秀樹 [理研]、広瀬恵子 [産総研]、守屋俊夫 [KEK]、小祝孝太郎 [KEK]、吉川雅英 [東大]、柳澤春明 [東大]、西澤知宏 [東大]、荒牧慎二 [TVIPS]、真柳浩太 [九大]、村田和義 [生理研]、宮崎直幸 [筑波大]、久保田孝幸 [KEK]、山田悠介 [KEK]、山下恵太郎 [東大]

*I-III 章は外部ユーザー向けの内容、IV 章は KEK スタッフ向けの内容、V 章は補遺となっています。

目次

I. オートグリッドの作製と電顕への導入

1. 器具の冷却など	p.03
2. クライオグリッドの作製	p.05
3. オートグリッドの作製	p.06
4. オートグリッドを Cassette・NanoCab 経由で電顕へ入れる	p.07

II. 自動データ測定

1. Inventory	p.08
2. EPU による自動測定 (Linear mode x 3 通り)	p.09
3. トラブルシューティング	p.13

<u>III. 後片付け</u>	p.16
------------------------	------

IV. 自動測定をする前に必要な準備

1. Autoloader の Conditioning (週 1 回)	p.17
2. およそのアラインメント (毎日)	p.17
3. C2 絞りの中心合わせ (毎日)	p.18
4. ピボットポイントの調整 (毎日)	p.19
5. Rotation Center (毎日)	p.19
6. 位相板への焦点合わせ (毎日)	p.20
7. 対物絞りの中心合わせ (毎日)	p.21
8. AutoCTF (毎日)	p.22
9. EPU における dose, fraction の設定 (毎日)	p.23
10. Gain reference (毎日)	p.24
11. EPU の倍率間の中心合わせ (毎日)	p.24
12. EPU のリスタート (必要に応じて)	p.24
13. EPU の Preparation の設定 (必要に応じて)	p.25
14. グリッドのアセトン処理 (必要に応じて)	p.27
15. グリッド作製用の液体窒素の補充 (必要に応じて)	p.27
16. 電顕用の 250L 液体窒素タンクの交換 (2 週間に 1 回くらい)	p.27
17. Counting mode での撮影 (高分解能解析用の画像を撮る場合 : Counting mode x 2 通り)	p.28
18. Image shift を用いた 3x3 hole の撮影方法	p.38
19. 長期休暇時の対応	p.39
20. 電顕のシャットダウンと立ち上げ (計画停電の前や故障時)	p.41
21. Talos Arctica のレンズ/絞りの構成	p.45

V. 補遺

1. KEK の計算環境で Relion tutorial を行う際のパラメーター設定	p.46
2. EPU-D を使わずに microED 測定を行う際の手順 (暫定版)	p.49

変更履歴

日本語第 01 版	18.05.11.	安達 成彦	初版
日本語第 02 版	18.05.13.	安達 成彦	軽微な変更
日本語第 03 版	18.05.13.	安達 成彦	FEI のカタログより写真を追加
日本語第 04 版	18.05.22.	安達 成彦	Section IV に追記
日本語第 05 版	18.05.22.	安達 成彦	軽微な変更
日本語第 06 版	18.06.11.	安達 成彦	重要事項を赤字に変更。位相板なし・Counting mode の測定条件を追加
日本語第 07 版	18.06.12.	安達 成彦	軽微な変更
日本語第 08 版	18.06.13.	安達 成彦	トラブルシューティングを追加
日本語第 09 版	18.06.14.	安達 成彦	軽微な変更
日本語第 10 版	18.06.15.	安達 成彦	Preparation の表の内容を変更
日本語第 11 版	18.06.16.	安達 成彦	軽微な変更
日本語第 12 版	18.06.25.	安達 成彦	変更履歴を追加
日本語第 13 版	18.07.09.	安達 成彦	ブレーカーが落ちた時の対応を追記。その他、各種変更
日本語第 14 版	18.07.18.	安達 成彦	作成協力の項目を追記
日本語第 15 版	18.07.26.	安達 成彦	軽微な変更
日本語第 16 版	18.08.07.	安達 成彦	電源のシャットダウンと立ち上げを追記
日本語第 17 版	18.08.23.	安達 成彦	Talos Arctica のレンズ構成などを追記
日本語第 18 版	18.10.11.	安達 成彦	EPU による自動測定の条件を 5 通りに場合分け
日本語第 19 版	18.10.15.	安達 成彦	AutoCTF, ピボットポイントの項目を変更。
日本語第 20 版	18.11.06.	安達 成彦	AutoCTF の順序を変更。トラブルシューティングを追加
日本語第 21 版	19.03.26.	安達 成彦	EPU, TEM User Interface の version up に伴い改訂
日本語第 22 版	19.03.28.	安達 成彦	Auto Eucentric の手順を改訂
日本語第 23 版	19.04.02.	安達 成彦	AutoCTF の手順を改訂
日本語第 24 版	19.04.11.	安達 成彦	アラインメントの手順について、部分的に変更
日本語第 25 版	19.07.02.	安達 成彦	LM での Eucentric focus を追加。Image shift を用いた撮影を追加。
日本語第 26 版	19.12.19.	安達 成彦	EPU, TEM User Interface の version up などに伴い改訂
日本語第 27 版	20.02.27.	安達 成彦	長期休暇時の対応などを追記。Section V. 補遺 (microED, Relion) を追記
日本語第 28 版	20.06.01.	安達 成彦	microED の項目などを改訂

英語第 1 版 20.##.##.##.##

日本語第 ## 版を英語に翻訳

I. オートグリッドの作製と電顕への導入

グリッド作製における全般的な注意点

*Grid に触れる全てのものが、すでに冷えた状態であるように気をつける。器具から出る泡が激しく沸騰した状態から小さい泡が出る状態になるまで待つから使う。

*一度液体窒素で冷やしたものを外に出すと霜がつくが、それを再度液体窒素に入れると、霜がグリッドに付いて良くない。なので、液体窒素の外に出さないか、新しいものを使うこと

1. 器具の冷却など

1L ポット x 4 に液体窒素を注ぐ。注ぎ口をアルミ箔でフタをする。

・ Vitrobot の立ち上げ

- ☐ Humidifier をはめる (**正しくはめないとステージとぶつかって故障します**)
- ☐ 下からシリンジで MQ 50mL を入れる (最後に少し引く)
- ☐ Vitrobot の電源を入れる (スイッチは装置の背面の右手下)
- ☐ タッチパネルで 18℃ (or 希望の温度), 100%, humidifier ON に設定
- ☐ Use Footpedal, Humidifier off, Skip grid transfer にチェックを入れる
- ☐ 2 回くらい踏んで、白いフタを閉じる
- ☐ ろ紙を 1 枚ずつ、左右にセット (手袋着用。切り口の曲がり方が外側を向くように)
- ☐ (ろ紙を入れて 1 時間たったら新しいものに取り替える)

・ Vitrobot 用の発泡スチロール容器の組み立てと冷却

- ☐ 組み立てて、500mL ビーカーでフタをする
- ☐ 周辺の堀とエタンカップ (金色) に液体窒素を注ぐ (2-3 回繰り返す、10 分以上待つ)
- ☐ 気体エタンを液体エタンにする。できるだけ、カップのフチぎりぎりまで作る。

注意：液体エタンは大変危険です。必ず防護メガネ・手袋を着用すること。もし目に入ると失明します。また、直接容器を持つと危ないのでフタに乗せて運びましょう。

- ☐ スパイダーを外す (そのままにすると、凍ってスパイダーが取れなくなります)
- ☐ エタンカップの内壁が白くなるくらいまで待つ

注意：液体エタンの温度は-89℃から-183℃まで幅があります。よいグリッドを作るには-160℃以下が望ましいと言われているので、固化するぎりぎりを使うのが良いそうです。一度固化させてからピンセットのお尻を入れて溶かす方法もあるそうです。

- ☐ CryoGrid Box (水色) を入れて、完全に冷えるまで数分待つ

・ Loading station の組み立てと冷却

- ☐ 組み立てる (500mL ビーカーで液体窒素の注ぎ口にフタをする)



- ☐ AutoGrid alignment tool (鉄) と AutoGrid container (白) を入れる



- ☐ 注ぎ口から液体窒素を注ぐ (霜の混入を防ぐため、注ぎ口にキムワイプを詰めておく)
- ☐ これを 2-3 回繰り返す
- ☐ 液体窒素が減らなくなってから、さらに 10 分以上待つ

(* この容器は液体窒素の減りが早いので、以降、こまめに液体窒素を継ぎ足しましょう)

・ NanoCab の冷却

- ☐ NanoCab に液体窒素を注ぐ



- ☐ 少し待つと半分くらいに減るので、再び液体窒素を入れる
- ☐ これを何回か繰り返す
- ☐ 液体窒素が減らなくなってから、さらに 10 分以上待つ

・ PIB-10 の空運転

- ☐ 朝一番で、PIB-10 を一度、空運転しておく

2. クライオグリッドの作製

- グリッドはあらかじめアセトンに一晩浸けた後、風乾させておく
- アセトン処理済みのグリッドを必要枚数だけ、先細ピンセットで取り出す
- ガラスプレパレートの上に、グリッドの裏面(ピカピカしたほう)を上にして並べる
- PIB-10 で親水化 (Hard, 1.5min → Start ボタンを押す)
- PIB-10 から取り出して、グリッドをひっくり返して、再度親水化 (Hard, 1.5min)
- Vitrobot の設定 (Blotting time を 15-20 秒に。もしくは 5 秒で blot force=10 など)

□Footpedal を何回か踏んで、ピンセットホルダーを下げる

- Vitrobot 用ピンセットでグリッドをつまんで黒い留め具で固定(振って落ちないか確認)



- ピンセットを Vitrobot にセット (*カーボン面(表面)が利き手側を向くように)
- Footpedal を 3 回踏んで、ピンセットを上を移動させる

- 発泡スチロール容器に十分量の液体窒素を注ぎ、Vitrobot のステージに置く
- Footpedal を 1 回踏んで、発泡スチロール容器を上を移動させる
- Footpedal を 1 回踏んで、ピンセットを下げる
- サンプルを 3 μ L スポット (*泡を作らない。少しチップに溶液が残ってもあきらめる)
- Footpedal を踏むと、グリッドが Blotting されて液体エタンにじゃぼんと浸かる
- ピンセットと発泡スチロール容器が下がってくる
- 霧が晴れるまで 20 秒くらい待つ (待っている間に液体窒素を注ぎ足す)
- 親指の腹で押すような感じでピンセットを外し、発泡スチロール容器ごと手元に移動
- グリッドはエタンの中に浸したまま、
ピンセットの黒い留め具の下を持ち、黒い留め具を少しずつ上にずらす
- グリッドをエタンから液体窒素へ移動
- グリッドを CryoGrid Box (水)に収納 (どの番号に何を入れたか記録しておく)
- 発泡スチロール容器に十分量の液体窒素を注ぐ
(#以降の操作を、サンプル数だけ繰り返します)

3. オートグリッドの作製

- ☐ Loading station に、再度、十分量の液体窒素を注ぐ
- ☐ CryoGrid Box (水色)のフタをシャーペン型治具にはめて、激しい沸騰が終わるまで待つ
- ☐ CryoGrid Box (水色)にフタをして、Loading station に移す

注意： **フタを扱う操作は静電気に注意。操作前にサンダルを脱いでアースする。**

- ☐ CryoGrid Box (水)のフタを外す
- ☐ C-clip insertion tool (白いシャーペンのような治具) に C-clip をはめる

注意： ゆがんだ C-clip を使うと電顕内で外れるので、 **ゆがんだものは捨てて下さい！**



- ☐ C-clip ring を Loading station に入れて冷やす



- ☐ 先細ピンセットを 30 秒くらい冷やす
- ☐ C-clip ring を AutoGrid alignment tool (鉄)の中央に置く
- ☐ グリッドを C-clip ring にはまるように置く
- ☐ C-clip をはめた C-clip insertion tool の先端を激しい沸騰が終わるまで待つ
- ☐ C-clip をカチャンとはめる（この状態がオートグリッド）
- ☐ **AutoGrid alignment tool の土手から落とすなどして、正しくはまったことを確認**

注意： オートグリッドがきちんと組み立てられていないと、電顕内部でロボットアームがグリッドを掴み損ねて落ちたり、破片が落ちたりします。もしそうになると、Autoloader 内で落ちた場合は修理に数日、鏡筒内で落ちた場合は修理に 1-2 週間かかるので、共同利用の運営に大きな支障が出ます。オートグリッドがきちんとできていることを、必ず確認して下さい！！！！必要に応じて拡大鏡を使うと良いです。

- ☐ AutoGrid container (白)に収納（どの番号に何を入れたか記録しておく）

4. オートグリッドを Cassette・NanoCab 経由で電顕へ入れる

- ☐ NanoCab に液体窒素を注ぎ足す
- ☐ 電顕の前に行って NanoCab をセットし、タッチパネルの Undock ボタンを押す
- ☐ Loading station に NanoCab をセット
- ☐ Cassette を NanoCab から Loading station に移動（把手の横のボタンを押すと掴む）



- ☐ AutoGrid tweezers（先が十字型のピンセット）を 30 秒から 1 分以上、冷やす



- ☐ AutoGrid tweezers で、オートグリッドを Cassette に移す（番号を記録しておく）
（*この時、C-clip ring が下(=普通に操作すると手前)になるように入れる）
- ☐ **AutoGrid tweezers を縦にして軽く押し、
全てのグリッドがきちんとはまっていることを必ず確認する**

- ☐ Cassette を NanoCab に戻す（把手の横のボタンを押すと掴む）

注意：Cassette がコテから外れにくいのですが、NanoCab に入れたらボタンを離して、下側に押し当てるように、手首を返すようにコテを動かすと、Cassette が NanoCab に残ります。ここで、**あまり無理にガチャガチャやると、オートグリッドがばらけてしまうので注意が必要**です。

- ☐ NanoCab を Loading station から外す
- ☐ NanoCab に液体窒素を注ぎ足す
- ☐ NanoCab のピンが上がっていることを確認（上がってなければ指でつまみあげる）
- ☐ 電顕の前に行って NanoCab をセットし、タッチパネルの Dock ボタンを押す
（NanoCab がうまく認識されない場合、ピンを少し回すと認識されることがありますが、
回しすぎるとピンが外れるので注意！）

II. 自動データ測定

*IV に示した事前準備が一通り終わっているならば、以下を行えば OK です。

*TEM User Interface は version 1.15.1、EPU は version 2.5.0.4799REL となっています。

1. Inventory

(*左側の画面の TEM User Interface を使います)

・ Autoloader>Temperature Control

- ☐ NanoCab の Dock が終了したら、
温度表示が全て緑になって、全てが-160℃以下になるまで待つ

・ Autoloader>Autoloader>Option

- ☐ Inventory ボタンを押す
- ☐ 入れたグリッドが全て正しく認識されたら OK
(正しく認識されなければ、もう一度 Inventory。それでダメなら FEI に電話します)
- ☐ 入れた Grid+2 までチェックが終わったら Stop Inventory のボタンを押して停止

2. EPU による自動測定 (*右側の画面の EPU を使います)**• Autoloader>Autoloader**

- ☐ 見たいグリッドの数字をクリックして Load ボタンを押す (*数分かかります)

• Setup>Vacuum

- ☐ Col. Valves Closed というボタンを押して、Column Valve を開ける

• Preparation タブ

- ☐ 左上の Presets のプルダウンメニューから Atlas を選ぶ

- ☐ 上部右端のカメラマークを押して Preview 撮影

(この段階でグリッドが見えなければ、カラムバルブが閉じているので開けましょう。

氷が厚すぎる場合も何も見えませんが、うっすら Grid square が見えるはずです。

どうしてもダメな場合は KEK スタッフか FEI に電話してください。)

• Atlas タブ

- ☐ **左側の画面の Search>Stage の option で z=180um に。**

- ☐ Session Setup : New Session _____ (番号を記録しておく)

- ☐ Atlas Acquisition : Start (*6x6 で全体像を撮影するのでしばらく待つ)

***KEK では、EPU による自動測定について、サンプルやグリッドの状態に応じて、以下の 5 通りの条件を用意しています。#1 は cryo sample screening、#2,3 は Liner mode での連続測定、#4,5 (p.36-37 に記載) は Counting mode での連続測定に使います。**

条件	位相板	モード	倍率	露光時間	Fraction	目的
#1	あり	Linear	92k	~3.5 秒*	12 枚	粒子状態/分布や氷の厚さを確認
#2	なし	Linear	92k	~3.5 秒*	~35 枚	Over night で測定して解析
#3	なし	Linear	120k	~3.5 秒*	~35 枚	Over night で測定して解析
#4	なし	Counting	92k	~60 秒*	50 枚	3 日連続測定して本解析
#5	なし	Counting	120k	~50 秒*	50 枚	3 日連続測定して本解析

測定条件#1：位相板あり・Linear・92k・～3.5 秒・12 枚

・ EPU タブ

☐ Session Setup : New session _____ (番号を記録しておく)

(*位相板を使う場合は、Use Phase Plate にチェックを入れること!)

(*保存先は Atlas と同じ folder を選ぶ。Quantifoil は R1.2/1.3 を選択)

☐ Square Selection : Unselect All, ホイールで拡大, Add, Move stage to grid square

☐ Hole selection : ひとまず Acquire で撮影。良い Square か確認。良ければ以下へ。

**画面中央で Hole がはっきりみえないなら Move stage here で移動
Auto Functions タブの Auto Eucentric by beam tilt を選ぶ
Presets から Hole/Eucentric を選び、Obj=none で Start
EPU タブに戻り Acquire (中央にいないなら中央に戻って Acquire)
measure Hole size, Find Hole, Unselect All, 右 click 等で Hole 選択**

☐ Template definition : Acquire, **C2=50, Obj=PhP4 に変更**, Find and Center Hole
add Acquisition Area: Defocus = **-1um**
add Autofocus Area: after distance = **10um**
add Drift Measurement Area: **once/grid**, 0.20nm/s

☐ Template Execution : Preview

☐ Automated Acquisition : **Set up>Aperture のオプションで位相板の Next を押す**
Start Run

(*位相板の影が出るので PhP4 の position 21-31, 39-51, 58-71 を使うのが良い)

☐ **測定条件#1 では、氷の厚い/薄い hole、もしくは hole の中央/端を丁寧に撮影して、
hole の明るさ (filter ice quality) と粒子の有無などの相関を確認しましょう**
(*撮影時の Skip 率が高い時は、Hole size, 高さ, アライメントを再確認しましょう)

測定条件#2 : 位相板なし・Linear・92k・~3.5 秒・~35 枚

・ EPU タブ

☐ Session Setup : New session _____ (番号を記録しておく)

(*保存先は Atlas と同じ folder を選ぶ。Quantifoil は R1.2/1.3 を選択)

☐ Square Selection : Unselect All, ホイールで拡大, Add, Move stage to grid square

☐ Hole selection : ひとまず Acquire で撮影。良い Square が確認。良ければ以下へ。

画面中央で Hole がはっきりみえないなら Move stage here で移動

Auto Functions タブの Auto Eucentric by beam tilt を選ぶ

Presets から Hole/Eucentric を選び、Obj=none で Start

EPU タブに戻り Acquire (中央にいないなら中央に戻って Acquire)

measure Hole size, Find Hole, Quality Bar & Brush tool

(複数の Square を選ぶなら、Square selection に戻る)

(必要なら、氷の厚さが異なるいくつかの hole, square を撮影)

☐ Hole を選び終わったら、カーボンの破れた所に移動

☐ Preparation タブで Data acquisition で set。C2=50, Obj=100 にする。

☐ Linear, Manual, No, Dose: ~50, fraction: ~35, 倍率: 92k にする。

☐ Dose Rate の measure を押し Get-get-get(e/A^2 を枚数で割り $e/A^2/\text{fraction}$ を計算)

☐ Template definition : Acquire, **C2=50, Obj=100 に変更**, Find and Center Hole

add Acquisition Area: Defocus = -0.5 - -1.5 or -1.5 - -3 um

add Autofocus Area: after distance = Always

add Drift Measurement Area: Always, 0.20nm/s

☐ Template Execution : Preview

☐ Automated Acquisition : Start Run

測定条件#3 : 位相板なし・Linear・120k・~3.5 秒・~35 枚

・ EPU タブ

☐ Session Setup : New session _____ (番号を記録しておく)

(*保存先は Atlas と同じ folder を選ぶ。Quantifoil は R1.2/1.3 を選択)

☐ Square Selection : Unselect All, ホイールで拡大, Add, Move stage to grid square

☐ Hole selection : ひとまず Acquire で撮影。良い Square が確認。良ければ以下へ。

画面中央で Hole がはっきりみえないなら Move stage here で移動

Auto Functions タブの Auto Eucentric by beam tilt を選ぶ

Presets から Hole/Eucentric を選び、Obj=none で Start

EPU タブに戻り Acquire (中央にいないなら中央に戻って Acquire)

measure Hole size, Find Hole, Quality Bar & Brush tool

(複数の Square を選ぶなら、Square selection に戻る)

(必要なら、氷の厚さが異なるいくつかの hole, square を撮影)

☐ Hole を選び終わったら、カーボンの破れた所に移動

☐ Preparation タブで Data acquisition で set。C2=50, Obj=100 にする。

☐ Linear, Manual, No, Dose: ~50, fraction: ~35, 倍率: 120k にする。

☐ Dose Rate の measure を押し Get-get-get(e/A^2 を枚数で割り $e/A^2/fraction$ を計算)

☐ Template definition : Acquire, **C2=50, Obj=100 に変更**, Find and Center Hole

add Acquisition Area: Defocus = -0.5 - -1.5 or -1.5 - -3 um

add Autofocus Area: after distance = Always

add Drift Measurement Area: Always, 0.20nm/s

☐ Template Execution : Preview

☐ Automated Acquisition : Start Run

3. トラブルシューティング

・ 8500x の画像がおかしい (画像が変に拡大されてしまう)

→ 高さの設定がずれて、おそらく $z=0\mu\text{m}$ になっています。Hole selection の際に高さ設定ができていないので、Skip Grid Square をしてから、同じ Square を Reopen した後に Hole selection のところまで戻り、Auto Eucentric か Auto Function 経由で高さ合わせをするか、EPU の session を新しく作りなおして下さい。

・ 自動測定中、750x の画像と 8500x の画像で、選んでいる Hole が異なる

→ 倍率間の中心合わせがずれているなら再設定します。EPU がバグっている場合は、一度測定を stop して、EPU を落とし、再度 EPU を立ち上げると改善することが多いです。ただし、狙った hole の隣に氷の張っていない hole があると、そちらを選んでしまう傾向もあります。

・ EPU の測定がいきなり停止するなどして、TEM User Interface の中央下の Prot.の表示が、普段の%ではなく、「?」や「Do calibration」となる。(=こうなるとカメラが温まり、Cooling (F)が赤/橙色になります)

→ 何らかの理由で操作 PC から Falcon カメラへの通信が行きっぱなしになった場合にこうなるそうです。この場合、一度 Falcon カメラをリセットする必要があります。以下にいくつかの対策を示します。

対策 1 : 操作 PC を log off/log in するか、再起動する。(これで治ればラッキー)

対策 2 : service 用の Microscope Software Launcher の Tools から、Camera and detector の Falcon Service Tool を選ぶ。現れた Window の CSU タブを選び、右下の Reboot CSU ボタンをクリックする。Basic Operations タブの Sensor temperature が下がり始めれば OK。-25℃まで下がって Cooling (F)が Stable (緑色)になるまで待つ。その後、Setup の FEG control の Guns lens の値を、4.2 から 4.1 にして、4.2 に戻すと、Do calibration が解除されるはずです。

対策 3 : 操作 PC を shut down した状態で、Falcon カメラコントローラーの電源ケーブルを一度抜いて刺し、PC を起動する。

・ 画像に水滴のようなものが見える

→位相板がチャージアップしすぎか、位相板にゴミがついています。Next ボタンで場所を変えるか、PhP2,3,4,5,6 などを使いましょう。

・ いきなりブレーカーが落ちた

→ 原因はよくわかりませんが、こうなったら基本的に、KEK スタッフか FEI に電話してください。念のため、復旧方法を以下に示します。

- ☐ 操作室の外に出て、電顕のブレーカーが落ちていることを確認
- ☐ 電顕室に戻り、電顕の操作 PC の少し上にある、メインスイッチを OFF にする
- ☐ ブレーカーを ON にしてから、メインスイッチを ON
- ☐ 操作 PC の起動後、User 用 Launcher で TUI を起動 (Hang up したら操作 PC を restart)
- ☐ User 用 Launcher を Exit して、Service 用 Launcher を立ち上げる
- ☐ Tools から、Vacuum test を選んで、
 - Manual Mode を click してから、IGPa, IGPco を click
 - それぞれが緑になったら、もう一度 Manual Mode を click
 - Evacuate All を押す
- ☐ Tools から、Autoloader Vacuum を選んで、Pump を押す
- ☐ Aperture の Option の Enable タブで、C2, Obj, SA を黄色にする
- ☐ FEG control の Option を見て、Power が押せるようになったら押す
- ☐ Auto Loader の Option を見て、Initialize
- ☐ Setup の High tension が押せるようになるまで待つ。
- ☐ 電源が落ちてから (or 落としてから) すぐ復帰するときは Warm start
- ☐ High tension の Option を見ながら、電圧を 80kV から 200kV に上げていく
- ☐ Ceta と Falcon を認識しない場合、TUI を再起動か、電源ボードのケーブルを抜き差し
- ☐ Tools から、Camera and detector の Falcon service tool を選ぶ
- ☐ CSU のタブを選んで待つ。だめなら Reboot する。(温度が -18℃/-25℃になるはず)
- ☐ Align>Alignments の Option を押して、File から 200 を選び、
 - Available にあるものを全て Selected に移動して、Apply を押す。
- ☐ Align>FEG register の file から、200kV TEM を選んで Set を押す。
- ☐ Auto Loader>Temp Control の Status を見て、
 - Error が出たら Option>State の Recover を押す

・ 自動測定中、Autofocus did not converge のエラーが出た

→ Tomography TEM で 22,000x, -10um など AutoFocus の Calibration をした後、EPU で 92,000x で自動測定しようとする、倍率が違いすぎるのでエラーが出ます。この場合、KEK スタッフを呼んでください。以下の通りに対応いたします。（*この操作は勝手に行わないでください！）

- ☐一通りのアラインメントを行う（*特に pivot point と高さがあってないとダメ）
- ☐Preparation tag で Hole/Eucentric にして set
- ☐カーボン膜上に移動
- ☐Hole/Eucentric にして Auto Eucentric by stage tilt
- ☐Preparation tag で Data Acquisition にして set
- ☐Data Acquisition にして Auto Eucentric by stage tilt
- ☐AutoFunction tag で、Data Acquisition を選ぶ
- ☐Calibration の AutoFocus を選んでスタート
- ☐あとは指示にしたがって進む

・ 8500x で Auto Eucentric や測定した後に 700x で測定すると、輪っかが見える

→ 見えている輪っかは、カーボン膜にたまった Charge の影響です。通常は見えないものなのですが、700x の defocus がきつすぎると見えます。TEM User Interface では、SA と LM で defocus 値をそれぞれ記憶していますが、LM の defocus が変な値を覚えている可能性があります。アラインメントの最初に、EPU の Preparation タブの Presets から Grid square を選んで、Eucentric focus ボタンを押すよう手順を変更したので、そのようにしてください。

・ Do calibration が出て、本当に Calibration をしないとイケない場合

→ Align>Alignments の Option で一連の File を右から左に移して Apply し、Align>FEG register で file を選んで Set。Falcon Camera>Falcon Protector Calibration から、プルダウンメニューの下 3 つ（Calibrate Microprobe, Nanoprobe, LM）を以下の順で実行。

- ・ Calibrate を押し C2 の Centering して（=Beam Shift で光を中央に移動）、Next
- ・ Intensity ダイアルで C2 Lens の値を 100%にして（=光を最大に広げて）、Next
- ・ Focus Beam と出る、Intensity ダイアルで光を一番小さくして中央に移動して、Next

III. 後片付け

・ Vitrobot の終了

- ☐ 扉を閉めて、タッチパネルの Exit を押す (Yes/No をきいてくるので Yes)
- ☐ しばらく経つと画面が暗くなるのでスイッチを切る
- ☐ Humidifier を外して、中の水を捨てる (よく振って捨てる)
- ☐ ろ紙を外して捨てる
- ☐ 扉は開けて中を乾燥させておく

・ Vitrobot 用の発泡スチロール容器

- ☐ 全てのパーツをばらして、キムタオルの上に並べる
 - ☐ そのまま置いて乾燥させる
- (*すぐに次の実験をしたい場合は、金属パーツはドライヤーで乾かし、
発泡スチロール部分はキムワイプなどで完全に水気をとる)

・ Loading station

- ☐ 全てのパーツをばらして、キムタオルの上に並べる
 - ☐ そのまま置いて乾燥させる
- (*すぐに次の実験をしたい場合は、他のよく乾いた Loading station を使う)

・ NanoCab の冷却

- ☐ 液体窒素を入れたまま、蓋もしたまま、翌日まで静置する
- (*すぐに次の実験をしたい場合は、他のよく乾いた NanoCab を使う)

注意：帰る前に必ず、以下の **4 点** について確認して下さい。

- ・ 電顕の **Column Valve** を閉じる (EPU で測定中なら測定後に閉じるボタンを押す)
- ・ 電顕を使ってない時は **位相板** を抜く (入れたまま真空が飛ぶと位相板が破れます)
- ・ 電顕を使ってない時は **カメラ** をはずす (何かの弾みでカメラが壊れるのを防げます)
- ・ **エタンガスボンベ** の Valve を閉じる

IV. 自動測定をする前に必要な準備

1. Autoloader の Conditioning (週 1 回 : 電顕内部のゴミ飛ばし)

- ☐ Autoloader>Temperature Control のオプションから State を選ぶ
- ☐ Temperature State の Go to を Conditioning Autoloader にして↵を押す
- ☐ After Conditioning のところは、
Go to All Nitrogen temperature を選んで、
At を復帰させたい日時 (*default では 12 時間後) にして↵を押す
(*Conditioning both については、計画停電や長期休暇のシャットダウンで行う)

2. およそのアラインメント (毎日)

- ☐ Setup>Apertures の Option の Options で、
一番上の check box (=React on optical mode changes) を外す
- ☐ Grid なしの状態で行う (もしくは Grid に穴のあいたところで行う)
- ☐ EPU の Preparation タブの Import で 001,002,003_.sxml file のいずれかを読み込む
 - *E:/Preparation/001_PhP_Linear_92k_191120.sxml を選択 (1.13A/pix)
 - *E:/Preparation/002_Linear_92k_191120.sxml (1.13A/pix)
 - *E:/Preparation/003_Linear_120k_191120.sxml (0.88A/pix)
- ☐ Column Valves を開く (蛍光板を下ろして光が来ているかを確認)
- ☐ Align>Alignments の Option を押して、File から 200 を選び、
Available にあるものを全て Selected に移動して、Apply を押す。
- ☐ Align>FEG register の file から、200kV TEM を選んで Set を押す。

3. C2 絞りの中心合わせ (毎日)

- ☐ Grid なしの状態で行う (もしくは Grid に穴のあいたところで行う)
- ☐ EPU の Preparation タブで、Grid Square にして set
- ☐ **操作パネルの Eucentric focus ボタンを押す (*700x で Obj lens=6.0968)**
- ☐ EPU の Preparation タブで、Data Acquisition にして set
- ☐ **操作パネルの Eucentric focus ボタンを押す (*92k で Obj lens=86.5740)**
- ☐ C2=50, Obj=none になっていることを確認。蛍光板を下ろし、倍率を 17500 倍に。

1 回目

- ☐ Intensity ダイアルを左に回してビームを絞る
- ☐ Direct Alignment から Beam shift を選び、Multi function ダイアルで光を中央に移動
- ☐ Intensity 右に回して光を画面いっぱい広げる
- ☐ C2 の横の Adjust を押して、Multi function ダイアルで、
光の円が画面の四辺に接するように移動する
- ☐ C2 の横の Adjust をもう一度押す

2 回目

- ☐ もう一度ビームを絞って、Multi function ダイアルで光を中央に移動
- ☐ Intensity 右に回して光を画面いっぱい広げる
- ☐ C2 の横の Adjust を押して、Multi function ダイアルで、
光の円が画面の四辺に接するように移動する
- ☐ C2 の横の Adjust をもう一度押す
(*ビームを絞った時も広げた時も中央にくるよう、以上を何回か繰り返す)
- ☐ Direct Alignment の Beam shift を Done する (*光の輪がほぼ同心円状に広がれば OK)
- ☐ C2=150 については確認のみで OK (Beam shift で光を動かさない)

4. ピボットポイントの調整（毎日：ビームティルトの設定）

- ☐ Grid なしの状態で行う（もしくは Grid に穴のあいたところで行う）
- ☐ EPU の Preparation タブで、Data Acquisition にして Set
- ☐ C2=50, Obj=none になっていることを確認。蛍光板を下ろす。
- ☐ 倍率を 28000 倍にして、Intensity で光を絞る
- ☐ Direct Alignment から、nP Beamtilt pp X を選ぶ
- ☐ Multi Function ダイアル X (と Y) で、点滅する 2 つの光が重なるように微調整する
- ☐ Direct Alignment から、nP Beamtilt pp Y を選んで同様に合わせる
- ☐ Done を押す

5. Rotation Center（毎日：電流軸を対物レンズの中心に通す）

- ☐ Autoloader を使って、何かグリッドを入れる
- ☐ Column Valve を Open して、EPU の Preparation タブで Atlas の Preview をとる
- ☐ Move stage here で、目立つゴミのあるところへ移動
- ☐ EPU の Preparation タブで Grid Square の Preview をとる
- ☐ Move stage here で、目立つゴミのあるところへ移動
- ☐ Search>Stage の option で z=180um に合わせる
- ☐ EPU の Preparation タブで Hole/Eucentric の Preview をとる
- ☐ Move stage here で、目立つゴミのある近くへ移動
- ☐ EPU の Auto Functions タブで、Hole/Eucentric にして Auto Eucentric by stage tilt

- ☐ 蛍光板を下ろして、倍率を 8500 倍から倍率 57000 倍にする。C2=150, Obj=none。
- ☐ このままだと暗くて何も見えないので Intensity を左に回す
- ☐ 目立つゴミを探して画面の中心に持ってくる
- ☐ Direct Alignment から、Rotation Center を選ぶ。
 - Multi Function ダイアルで、ゴミが上下左右に動かなくなるように微調整する
 - （*この後、AutoCTF でコマ収差を除くので、ある程度あっていれば良いそうです）
- ☐ Done を押す

6. 位相板への焦点合わせ (毎日)

(*透過波だけの位相を変えたいが、位相板のところでビームが点になっていないと、散乱波も位相がずれてしまうので、位相板のある後焦点面に焦点を合わせる。)

☐ 位相板ヒーターの電源が入っていることを確認 (*電源 ON にした後は 2 時間程待つ)

☐ 蛍光板を上げる

☐ EPU の EPU タブの Square selection など、やぶけて穴が空いているところに移動

☐ 蛍光板を下げる

☐ Preparation タブで、Data Acquisition で Set

☐ 倍率を 13500 倍に下げて、C2: 150 (視野を広げる)、**位相板 (PhP4) を入れる**

(*位相板の影が出るので PhP4 の position 21-31, 39-51, 58-71 を使うのが良い)

☐ TUI の表示モードを Linear にする (そのほうが見やすい)

☐ ヒストグラムのところ、ピークのみを選んで、もやもやが見えるようにする

☐ Intensity を Fine にして、左右に回して focus を合わせる

(*Intensity を回すと、もやもや→縦シマ→白→横シマ→もやもや、などと変わるので、左右に行ったり来たりして、シマシマの向きが 90 度変わるところを探す)

☐ Stigmator を Condensor にして、Multifunction X,Y で後焦点面に焦点を合わせる

(*それなりにコツがいるが、シマシマを伸ばす感じでやると上手くいく。

シマシマが見えるのは、ビームが楕円になっているということ)

終わったら、像が消えるところで Intensity ダイアルを止めて (=Just focus)

None を押す (***これ以降、Intensity ダイアルは触らないこと**)

☐ Phase plate は、Setup>Apertures の Option>Phase Plate を選んで、Next を押す

☐ TUI の表示モードを Natural に戻す

☐ 倍率 92000 倍、C2 絞りを 50、Obj 絞りを PhP4 or 100 にする

☐ EPU の Preparation タブで、

Data Acquisition にして Get

Autofocus にして Get

Drift Measurement にして Get

*参考：平行照射になる C2 Lens の目安の値 (%) Spot 11: 36.3%, 9: 36.94%,

Spot 8: 37.8%, 7: 38.5%, 6: 39.55%, 5: 40.7%, **4: 42.0%**

7. 対物絞りの中心合わせ (毎日)

- ☐ 位相板への焦点合わせの後に行う (= 平行照射の状態で行う)
- ☐ 蛍光板を上げて、ゴミのあるところへ移動 (C2: 50, Obj: none)
- ☐ EPU の Auto Functions タブで、Hole/Eucentric にして Auto Eucentric by stage tilt

☐ EPU の Preparation タブで Hole/Eucentric にして撮影。ゴミのないカーボン面へ移動

☐ EPU の Preparation タブで、Data Acquisition にして set

☐ C2=50, Obj=none

☐ **必ず蛍光板を下ろす**

(* 蛍光板を下ろさずに Diffraction ボタンを押すとカメラが壊れることがあります)

☐ Diffraction のボタンを押す (EPU でエラーが出るが、無視して次に進む)

☐ D=530mm くらいになっていることを確認

☐ Obj=100

☐ TUI は HDR モードにする

* ほぼ合っているはずなので、一応確認はするが、以下 3 点はやらないほうが無難

(☐ Objective の横の Adjust を押す)

(☐ Multi Function ダイアルで、明るい光の中心とぼやとした光の中心が合うようにする)

(☐ Objective の横の Adjust をもう一度押す)

☐ Diffraction ボタンをもう一度押して終了 (EPU のエラーに対しては Yes を押す)

8. AutoCTF (毎日：非点収差・コマ収差の補正)

- ☐ゴミのあまりないカーボン膜上に移動 (C2: 50, Obj: none)
- ☐Hole/Eucentric の倍率で高さ合わせ (*対物絞りの中心合わせでやってあれば不要)
- ☐Reset Defocus (=R2 を押す)

- ☐EPU の Preparation タブで、Data Acquisition で Set (**C2: 50, Obj: none**)
- ☐倍率 57000 倍にする
- ☐光がずれていたら、Beam Shift で中央に
- ☐もう一度、Data Acquisition で Set して、倍率 57000 倍にする
- ☐蛍光板を上げる
- ☐カメラを Falcon にする (Autoloader>CCD/TV Camera で BM-Falcon にして Insert)
- ☐Microscope Software Launcher の Tools から Sherpa を立ち上げる (少し時間かかる)
(*Auto Functions タブ経由でも可能ですが、失敗してもエラーが出ない点がイマイチ)

- ☐Linear mode なら Electron counting のボックスのチェックは外す。
(Exp.: 4, Binning: 2, Readout: Full, Auto-focus-to: チェックして-2.0)
- ☐Objective Stigmation の Measure を押す (*グリッドに跡がついてたら少し移動)
(トーンリングが拾えなければ Focus ダイヤルを回して Defocus を-800nm かける)
- ☐トーンリングが拾えたら、Correct を押す
(対物レンズの非点収差をとってくれる。光があまり暗いと拾ってくれない)
(途中で Stop しないこと。Stop すると途中の変な状態で止まってしまう)

- ☐右下に Passed と出たら、Coma の Correct を押す (コマ収差をとってくれる)

- ☐右下に Passed と出たら、**C2: 50, Obj: 100** にして、
もう一度、Objective Stigmation の Correct を押す
(*1 次の収差が focus、2 次の収差が非点収差、3 次の収差がコマ収差)

(*AutoCTF が全くうまくいかない場合は、何かが変です。アラインメントを最初からやり直しましょう。)

9. EPU における dose, fraction の設定 (毎日)

- ☐ Grid に穴のあいたところに移動
- ☐ EPU の Preparation タブの Presets を Data Acquisition にして Set
- ☐ C2: 50, Obj: 100
- ☐ Exposure Settings を Linear, Manual, No, Dose= ~ 50 , Fractions=12 or ~ 35 にする
- ☐ Dose Rate のところの Measure ボタンを押す
- ☐ Exp. time= ~ 3.5 になったことを確認 (~ 14 e/px/s くらいになるはず)
- ☐ EPU の Preparation タブで、
 - Data Acquisition にして Get
 - Autofocus にして Get
 - Drift Measurement にして Get

10. Gain reference (毎日：カメラのゼロ点合わせ)

- ☐ Grid なしの状態で行う（もしくは Grid に穴のあいたところで行う）
- ☐ 蛍光板を下げる
- ☐ EPU の Preparation タブで、Data Acquisition にして Set
- ☐ 倍率: 28000/36000, C2: 150, Obj: 100。光が画面全体に当たっていることを確認
- ☐ CCD/TV camera のオプションから Bias Gain を選ぶ
- ☐ Reference Image Manager を押す
- ☐ Linear mode なので、normal@日付のファイルを選ぶ
- ☐ 蛍光板を上げて、measure dose を押す
- ☐ バーが緑の範囲に入っていないければ、Intensity, Spot size, Mag で調節
- ☐ 蛍光板を上げて、measure dose を押す（50/30%くらいになるはず）
- ☐ 以上の手続きを繰り返して、バーを緑の中に入れる
 - （*値が小さすぎる場合は、Beam Blank や Camera Insert がおかしくないか確認。
 - なお、平行照射にしたいので **Spot size: 4 なら C2 Lens 42.0%** くらいのはず）
- ☐ バーが緑の範囲に来たら Exp:10, #Image to Average: 4 として
Acquired Selected Gain Reference を押す
- ☐ 日付が update されたことを確認
- ☐ EPU の Preparation タブの Data Acq, Preview で、像が flat なことを確認して完了

11. EPU の倍率間の中心合わせ (毎日)

- ☐ Atlas で、低倍率から高倍率まで見えそうな、目立つゴミを探す
- ☐ Preparation タブに戻って、Calibrate Image Shifts、Start Calibration
- ☐ 92000x で見る。よければ Proceed
- ☐ 8500x で見る。92000x と対応する場所をダブルクリックして Proceed
- ☐ 700x で見る。8500x と対応する場所をダブルクリックして Proceed
- ☐ 115x で見る。700x と対応する場所をダブルクリックして Proceed
- ☐ finish successfully と出たら終わり

12. EPU のリスタート (必要に応じて)

- ☐ EPU の window が開いてたら、閉じる。
- ☐ Windows の Start から、EPU を立ち上げれば OK。

13. EPU の Preparation の設定 (必要に応じて)

以下に、EPU の Preparation の設定例を、参考として示す。

測定条件#1 : Linear mode_92k (*E:/Preparation/001_PhP_Linear_92k_191120.sxml)

	Camera	Binning	Readout	Exp. time, etc.	Probe	Mag	Defocus	Spotsize	Int.
Atlas	Falcon	2	Full	0.50	Micro	115x	-1000	8	1.103
Grid Sq	Falcon	2	Full	2.99	Micro	700x	-200	8	0.685 C2: 60%
Hole/ Eucentric	Falcon	2	Full	Linear,No 1.00	Nano	8500x	-50	8	0.548
Data Acq	Falcon	1	Full	Linear,Man,No ~50e/Å ² ~3.5 s, 12 fr	Nano	92000x	-2	4	0.456
Autofocus	Falcon	2	Full	Linear,No 0.50	Nano	92000x	なし	4	0.456
Drift mes	Falcon	2	Full	Linear,No 1.00	Nano	92000x	-5	4	0.456

*~4.2 e/Å²/fraction

測定条件#2 : Linear mode_92k (*E:/Preparation/002_Linear_92k_191120.sxml)

	Camera	Binning	Readout	Exp. time, etc.	Probe	Mag	Defocus	Spotsize	Int.
Data Acq	Falcon	1	Full	Linear,Man,No ~50e/Å ² , ~3.5 s, ~35 fr	Nano	92000x	-2	4	0.456
Autofocus	Falcon	2	Full	Linear,No 0.50	Nano	92000x	なし	4	0.456
Drift mes	Falcon	2	Full	Linear,No 1.00	Nano	92000x	-5	4	0.456

*~1.4 e/Å²/fraction

測定条件#3 : Linear mode_120k (*E:/Preparation/003_Linear_120k_191120.sxml)

	Camera	Binning	Readout	Exp. time, etc.	Probe	Mag	Defocus	Spotsize	Int.
Data Acq	Falcon	1	Full	Linear,Man,No ~50e/Å ² , ~3.5 s, ~35 fr	Nano	120000x	-2	4	0.456
Autofocus	Falcon	2	Full	Linear,No 0.50	Nano	120000x	なし	4	0.456
Drift mes	Falcon	2	Full	Linear,No 1.00	Nano	120000x	-5	4	0.456

*~1.4 e/Å²/fraction

測定条件#4 : Counting mode_92k (*E:/Preparation/004_Counting_92k_191120.sxml)

参考例	Camera	Binning	Readout	Exp. time, etc.	Probe	Mag	Defocus	Spotsize	Int.
Data Acq	Falcon	1	Full	Counted,Man,No ~50e/Å ² , ~60 s, 50 fr	Nano	92000x	-2	8	0.394
Autofocus	Falcon	2	Full	Linear,No 0.50	Nano	92000x	なし	8	0.394
Drift mes	Falcon	2	Full	Linear,No 1.00	Nano	92000x	-5	8	0.394

*~1.0 e/Å²/fraction**測定条件#5 : Counting mode_120k (*E:/Preparation/005_Counting_120k_191120.sxml)**

参考例	Camera	Binning	Readout	Exp. time, etc.	Probe	Mag	Defocus	Spotsize	Int.
Data Acq	Falcon	1	Full	Counted,Man,No ~50e/Å ² , ~50 s, 50 fr	Nano	120000x	-2	8	0.394
Autofocus	Falcon	2	Full	Linear,No 0.50	Nano	120000x	なし	8	0.394
Drift mes	Falcon	2	Full	Linear,No 1.00	Nano	120000x	-5	8	0.394

*~1.0 e/Å²/fraction

14. グリッドのアセトン処理（必要に応じて）

- ☐作業はステンレス机の上で行う
 - （*普通の机だと、アセトンで机の表面が溶けてシャーレが机にくっつくことがある）
- ☐ガラスシャーレにろ紙を敷く
- ☐ろ紙の上に、丁寧にグリッドを 25 枚くらい並べる（静電気に注意）
- ☐グリッドが浸るように、ゆっくりアセトンを注ぐ
- ☐室温で静置（over night）
 - （*カーボングリッド作成時に残ったプラスチックが溶けるので、親水性が上がる）
- ☐キムワイブなどでアセトンをできるだけ吸い取る
- ☐ピンセットで新しいろ紙の上にグリッドを移動させる
- ☐ガラスシャーレでフタをして、1 時間は置いて乾燥させる
- ☐グリッドを白い長方形のグリッドボックスに収納
 - （*静電気に注意。グリッドボックスのフタでグリッドを曲げぬよう注意）

15. グリッド作製の液体窒素の補充（必要に応じて）

- ☐朝、5L シーベル x2 本に、120L 液体窒素タンクから汲み出す

16. 電顕用の 250L 液体窒素タンクの交換（2 週間に 1 回くらい）

- ☐Autoloader の Option から、Fill Now を選んでしばらく待つ
- ☐バルブを全て閉じる（取り出し口の緑と、黒）
- ☐電顕とつながっている黒いホースとプラスチックチューブを外す
- ☐250L 液体窒素タンクを入れ替え
- ☐電顕とつながっている黒いホースとプラスチックチューブをつなげる
- ☐取り出し口の緑と、黒を全開

17. Counting mode での撮影（高分解能解析用の画像を撮る場合）

・およそのアラインメント

- ☐ Setup>Apertures の Option の Options で、
一番上の check box (=React on optical mode changes) を外す
- ☐ Grid なしの状態で行う（もしくは Grid に穴のあいたところで行う）
- ☐ EPU の Preparation タブの Import で、004_.sxml または 005_.sxml file を読み込む
 - *E:/Preparation/004_Counting_92k_191120.sxml (1.13A/pix)
 - *E:/Preparation/005_Counting_120k_191120.sxml (0.88A/pix)
- ☐ Column Valves を開く（蛍光板を下ろして光が来ているかを確認）
- ☐ Align>Alignments の Option を押して、File から 200 を選び、
Available にあるものを全て Selected に移動して、Apply を押す。
- ☐ Align>FEG register の file から、200kV TEM を選んで Set を押す。

・ C2 絞りの中心合わせ

- ☐ Grid なしの状態で行う（もしくは Grid に穴のあいたところで行う）
- ☐ EPU の Preparation タブで、Grid Square にして set
- ☐ **操作パネルの Eucentric focus ボタンを押す（*700x で Obj lens=6.0968）**
- ☐ EPU の Preparation タブで、Data Acquisition にして set。
- ☐ **操作パネルの Eucentric focus ボタンを押す（*92k で Obj lens=86.5740）**
- ☐ C2=50, Obj=none になっていることを確認。蛍光板を下ろし、倍率を 17500 倍に。

1 回目

- ☐ Intensity ダイアルを左に回してビームを絞る
- ☐ Direct Alignment から Beam shift を選び、Multi function ダイアルで光を中央に移動
- ☐ Intensity 右に回して光を画面いっぱい広げる
- ☐ C2 の横の Adjust を押して、Multi function ダイアルで、
光の円が画面の四辺に接するように移動する
- ☐ C2 の横の Adjust をもう一度押す

2 回目

- ☐ もう一度ビームを絞って、Multi function ダイアルで光を中央に移動
- ☐ Intensity 右に回して光を画面いっぱい広げる
- ☐ C2 の横の Adjust を押して、Multi function ダイアルで、
光の円が画面の四辺に接するように移動する
- ☐ C2 の横の Adjust をもう一度押す
(*ビームを絞った時も広げた時も中央にくるよう、以上を何回か繰り返す)
- ☐ Direct Alignment の Beam shift を Done する (*光の輪がほぼ同心円状に広がれば OK)
- ☐ C2=150 については確認のみで OK (Beam shift で光を動かさない)

・ ピボットポイントの調整

- ☐ Grid なしの状態で行う（もしくは Grid に穴のあいたところで行う）
- ☐ EPU の Preparation タブで、Data Acquisition にして Set
- ☐ C2=50, Obj=none になっていることを確認。蛍光板を下ろす。
- ☐ 倍率を 28000 倍にして、Intensity で光を絞る
- ☐ Direct Alignment から、nP Beamtilt pp X を選ぶ
- ☐ Multi Function ダイアル X (と Y) で、点滅する 2 つの光が重なるように微調整する
- ☐ Direct Alignment から、nP Beamtilt pp Y を選んで同様に合わせる
- ☐ Done を押す

・ Rotation Center

- ☐ Autoloader を使って、何かグリッドを入れる
 - ☐ Column Valve を Open して、EPU の Preparation タブで Atlas の Preview をとる
 - ☐ Move stage here で、目立つゴミのあるところへ移動
 - ☐ EPU の Preparation タブで Grid Square の Preview をとる
 - ☐ Move stage here で、目立つゴミのあるところへ移動
 - ☐ Search>Stage の option で z=180um に合わせる
 - ☐ EPU の Preparation タブで Hole/Eucentric の Preview をとる
 - ☐ Move stage here で、目立つゴミのある近くへ移動
 - ☐ EPU の Auto Functions タブで、Hole/Eucentric にして Auto Eucentric by stage tilt
-
- ☐ 蛍光板を下ろして、倍率を 8500 倍から倍率 57000 倍にする。C2=150, Obj=none。
 - ☐ このままだと暗くて何も見えないので Intensity を左に回す
 - ☐ 目立つゴミを探して画面の中心に持ってくる
 - ☐ Direct Alignment から、Rotation Center を選ぶ。
- Multi Function ダイアルで、ゴミが上下左右に動かなくなるように微調整する
 (*この後、AutoCTF でコマ収差を除くので、ある程度あっていれば良いそうです)
- ☐ Done を押す

・位相板への焦点合わせ

(*透過波だけの位相を変えたいが、位相板のところでビームが点になっていないと、散乱波も位相がずれてしまうので、位相板のある後焦点面に焦点を合わせる。)

☐ 位相板ヒーターの電源が入っていることを確認 (*電源 ON にした後は 2 時間程待つ)

☐ 蛍光板を上げる

☐ EPU の EPU タブの Square selection など、やぶけて穴が空いているところに移動

☐ 蛍光板を下げる

☐ Preparation タブで、Data Acquisition で Set

☐ 倍率を 13500 倍に下げて、C2: 150 (視野を広げる)、**位相板 (PhP4) を入れる**

(*位相板の影が出るので PhP4 の position 21-31, 39-51, 58-71 を使うのが良い)

☐ TUI の表示モードを Linear にする (そのほうが見やすい)

☐ ヒストグラムのところ、ピークのみを選んで、もやもやが見えるようにする

☐ Intensity を Fine にして、左右に回して focus を合わせる

(*Intensity を回すと、もやもや→縦シマ→白→横シマ→もやもや、などと変わるので、左右に行ったり来たりして、シマシマの向きが 90 度変わるところを探す)

☐ Stigmator を Condensor にして、Multifunction X,Y で後焦点面に焦点を合わせる

(*それなりにコツがいるが、シマシマを伸ばす感じでやると上手くいく。

シマシマが見えるのは、ビームが楕円になっているということ)

終わったら、像が消えるところで Intensity ダイアルを止めて (=Just focus)

None を押す (***これ以降、Intensity ダイアルは触らないこと**)

☐ Phase plate は、Setup>Apertures の Option>Phase Plate を選んで、Next を押す

☐ TUI の表示モードを Natural に戻す

☐ 倍率 92000 倍 or 120000 倍、C2 絞りを 50、Obj 絞りを 100 にする

☐ EPU の Preparation タブで、

Data Acquisition にして Get

Autofocus にして Get

Drift Measurement にして Get

*参考：平行照射になる C2 Lens の目安の値 (%) Spot 11: 36.3%, 9: 36.94%,

Spot 8: 37.8%, 7: 38.5%, 6: 39.55%, 5: 40.7%, 4: 42.0%

・対物絞りの中心合わせ

- ☐位相板への焦点合わせの後に行う（=平行照射の状態で行う）
- ☐蛍光板を上げて、ゴミのあるところへ移動（C2: 50, Obj: none）
- ☐EPU の Auto Functions タブで、Hole/Eucentric にして Auto Eucentric by stage tilt

- ☐EPU の Preparation タブで Hole/Eucentric にして撮影。ゴミのないカーボン面へ移動
- ☐EPU の Preparation タブで、Data Acquisition にして set
- ☐C2=50, Obj=none
- ☐必ず蛍光板を下ろす
 - （*蛍光板を下ろさずに Diffraction ボタンを押すとカメラが壊れることがあります）
- ☐Diffraction のボタンを押す（EPU でエラーが出るが、無視して次に進む）
- ☐D=530mm くらいになっていることを確認
- ☐Obj=100
- ☐TUI は HDR モードにする
 - *ほぼ合っているはずなので、一応確認はするが、以下 3 点はやらないほうが無難
- （☐Objective の横の Adjust を押す）
- （☐Multi Function ダイアルで、明るい光の中心とぼやとした光の中心が合うようにする）
- （☐Objective の横の Adjust をもう一度押す）
- ☐Diffraction ボタンをもう一度押して終了（EPU のエラーに対しては Yes を押す）

・ AutoCTF

- ☐ ゴミのあまりないカーボン膜上に移動 (C2: 50, Obj: none)
 - ☐ Hole/Eucentric の倍率で高さ合わせ (*対物絞りの中心合わせでやってあれば不要)
 - ☐ Reset Defocus (=R2 を押す)

 - ☐ EPU の Preparation タブで、Data Acquisition で Set (**C2: 50, Obj: none**)
 - ☐ 倍率 92000 倍 or 120000 倍のまま
 - ☐ 光がずれていたら、Beam Shift で中央に
 - ☐ もう一度、Data Acquisition で Set して、倍率 92000 倍 or 120000 倍のまま
 - ☐ 蛍光板を上げる
 - ☐ カメラを Falcon にする (Autoloader>CCD/TV Camera で BM-Falcon にして Insert)
 - ☐ Microscope Software Launcher の Tools から Sherpa を立ち上げる (少し時間かかる)
(*Auto Functions タブ経由でも可能ですが、失敗してもエラーが出ない点がイマイチ)

 - ☐ **Electron counting のボックスにチェックを入れる**
(**Exp.: 8**, Binning: 2, Readout: Full, Auto-focus-to: チェックして-2.0)
 - ☐ Objective Stigmation の Measure を押す (*グリッドに跡がついてたら少し移動)
(トーンリングが拾えなければ Focus ダイヤルを回して Defocus を-800nm かける)
 - ☐ トーンリングが拾えたら、Correct を押す
(対物レンズの非点収差をとってくれる。光があまり暗いと拾ってくれない)
(途中で Stop しないこと。Stop すると途中の変な状態で止まってしまう)

 - ☐ 右下に Passed と出たら、Coma の Correct を押す (コマ収差をとってくれる)
- *Linear mode で AutoCTF をした後に、EC mode で AutoCTF をすると、Spot size が 4 から 8 になっているため、成功しても Thon ring の見た目がイマイチな場合があります。その時は、Objective Stigmation-Coma をもう一度やるのが良いでしょう
-
- ☐ 右下に Passed と出たら、**C2: 50, Obj: 100** にして、
もう一度、Objective Stigmation の Correct を押す
(*1 次の収差が focus、2 次の収差が非点収差、3 次の収差がコマ収差)

・ EPU における dose, fraction の設定

- ☐ Grid に穴のあいたところに移動
- ☐ EPU の Preparation タブの Presets を Data Acquisition にして Set
- ☐ C2: 50, Obj: 100
- ☐ Exposure Settings を、Counted, Manual, No, Dose= ~ 50 , Fractions= 50 に
- ☐ Dose Rate のところの Measure ボタンを押す
- ☐ 92000 倍なら Exp. time= ~ 60 になったことを確認 ($0.83 \text{ e}/\text{\AA}^2/\text{s}$ くらい)
120000 倍なら Exp. time= ~ 50 になったことを確認 ($0.98 \text{ e}/\text{\AA}^2/\text{s}$ くらい)
- ☐ EPU の Preparation タブで、
 - Data Acquisition にして Get
 - Autofocus にして Get
 - Drift Measurement にして Get

*参考：東大の Talos Arctica での設定（位相板なし・Counting mode）

Mag. 190Kx, Spot 7
C2 38.455 % for acquisition (parallel illumination)
C2 33.500 % for focusing
Pixel size (uncalibrated) $0.76 \text{ \AA}/\text{pix}$
Exposure rate (no sample): $0.78 \text{ e}/\text{pix}/\text{s}$
Total dose $50 \text{ e}/\text{\AA}^2$
48 fractions (movie frames)
Exposure time 37.70 s, Align "Yes" (←KEK だと No にしたほうが良いかも,,,))

・ Counting mode 用の Gain Reference をとる (*90 分以上かかります)

- ☐ Grid なしの状態で行う (もしくは Grid に穴のあいたところで行う)
- ☐ 蛍光板を下げる
- ☐ EPU の Preparation タブで、Data Acquisition にして Set
- ☐ 倍率: 120K、C2: 50、Obj: 100、Spot size: 8。
光が画面全体に当たっていることを確認。

- ☐ CCD/TV camera のオプションから Bias Gain を選ぶ
- ☐ Reference Image Manager を押す
- ☐ Counting mode なので、pre_ec@日付のファイルを選ぶ
- ☐ 蛍光板を上げて、measure dose を押す
- ☐ バーは緑の範囲に入っているはず (もしも入ってなければ何かおかしい)
(*Falcon 3EC は 0.7 el/pix が適切とのこと)
(*値が小さすぎる場合は、蛍光板, Beam Blank, Camera Insert が正しいかを確認。
なお、平行照射にしたいので **Spot size: 8 なら C2 Lens 37.8%**くらいにする)

- ☐ バーが緑の範囲に来たら、Acquired Selected Gain Reference を押す (45 分かかる)
- ☐ 日付が update されたことを確認

- ☐ post_ec@日付についても同様にやる (45 分かかる)

- ☐ EPU の Preparation タブの Data Acq, Preview で、像が flat なことを確認して完了

測定条件#4 : 位相板なし・Counting・92k・~60 秒・50 枚

・ EPU タブ

☐ Session Setup : New session _____ (番号を記録しておく)

(*保存先は Atlas と同じ folder を選ぶ。Quantifoil は R1.2/1.3 を選択)

☐ Square Selection : Unselect All, ホイールで拡大, Add, Move stage to grid square

☐ Hole selection : ひとまず Acquire で撮影。良い Square か確認。良ければ以下へ。

画面中央で Hole がはっきりみえないなら Move stage here で移動

Auto Functions タブの Auto Eucentric by beam tilt を選ぶ

Presets から Hole/Eucentric を選び、Obj=none で Start

EPU タブに戻り Acquire (中央にいないなら中央に戻って Acquire)

measure Hole size, Find Hole, Quality Bar & Brush tool

(複数の Square を選ぶなら、Square selection に戻る)

(必要なら、氷の厚さが異なるいくつかの hole, square を撮影)

☐ Hole を選び終わったら、カーボンの破れた所に移動

☐ Preparation タブで Data acquisition で set。C2=50, Obj=100 にする。

☐ Counted, Manual, No, Dose: ~50, fractions: 50, 倍率: 92k にする。

☐ Dose Rate の measure を押し Get-get-get(e/A^2 を枚数で割り $e/A^2/\text{fraction}$ を計算)

☐ Template definition : Acquire, **C2=50, Obj=100 に変更**, Find and Center Hole

add Acquisition Area: Defocus = -0.5 - -1.5 or -1.5 - -3 um

add Autofocus Area: after distance = Always

add Drift Measurement Area: Always, 0.20nm/s

☐ Template Execution : Preview

☐ Automated Acquisition : Start Run

測定条件# 5 : 位相板なし・Counting・120k・~50 秒・50 枚

・ EPU タブ

☐ Session Setup : New session _____ (番号を記録しておく)

(*保存先は Atlas と同じ folder を選ぶ。Quantifoil は R1.2/1.3 を選択)

☐ Square Selection : Unselect All, ホイールで拡大, Add, Move stage to grid square

☐ Hole selection : ひとまず Acquire で撮影。良い Square か確認。良ければ以下へ。

画面中央で Hole がはっきりみえないなら Move stage here で移動

Auto Functions タブの Auto Eucentric by beam tilt を選ぶ

Presets から Hole/Eucentric を選び、Obj=none で Start

EPU タブに戻り Acquire (中央にいないなら中央に戻って Acquire)

measure Hole size, Find Hole, Quality Bar & Brush tool

(複数の Square を選ぶなら、Square selection に戻る)

(必要なら、氷の厚さが異なるいくつかの hole, square を撮影)

☐ Hole を選び終わったら、カーボンの破れた所に移動

☐ Preparation タブで Data acquisition で set。C2=50, Obj=100 にする。

☐ Counted, Manual, No, Dose: ~50, fractions: 50, 倍率: 120k にする。

☐ Dose Rate の measure を押し Get-get-get(e/A^2 を枚数で割り $e/A^2/\text{fraction}$ を計算)

☐ Template definition : Acquire, **C2=50, Obj=100 に変更**, Find and Center Hole

add Acquisition Area: Defocus = -0.5 - -1.5 or -1.5 - -3 um

add Autofocus Area: after distance = Always

add Drift Measurement Area: Always, 0.20nm/s

☐ Template Execution : Preview

☐ Automated Acquisition : Start Run

18. Image shift を用いた 3x3 hole の撮影方法

□Hole を選ぶ際、3x3 の撮影に合わせて、2 コ飛ばしで Hole を選ぶ

(*Square の端の Hole を選ばないように気をつける)

□EPU の Preparation にて、Presets を Hole/Eucentric にして set

- ・倍率を 8500x から 4300x に変更 (*KEK だとこの倍率で 3x3 が 1 画面に入る)
- ・NanoProbe から MicroProbe に変更 (*Dose protection かかるなら Intensity 弱める)
- ・Spot Size=4、Exp. Time=2sec に変更
- ・いったん set を押して、操作パネルの Intensity ダイアルを使って C2 Lens = 80%
- ・Hole/Eucentric のまま Get

***3x3 で測定する場合、以下の赤字部分を変更することになります**

	Camera	Binning	Readout	Exp. time, etc.	Probe	Mag	Defocus	Spotsize	Int.
Hole/ Eucentric	Falcon	2	Full	Linear, No 2.00	Micro	4300x	-50	4	0.848 C2: 80%

□Obj=none にする

□Template definition で、Acquisition Area を置く際、

- ・Max Image Shift=10 に変更 (値が小さいと Image shift を許容できずエラーが出る)
- ・Defocus について、-1 ~ -2.5um に設定する場合、
1 枚ずつ撮影するとき、もし-1um, -1.5um, -2um, -2.5um としているなら、
最初の 9 つを-1um、次の 9 つを-1.3um、次の 9 つを-1.6um、、、など、
少し細かめに設定 (*Skip 時に特定の defocus がごっそり抜けるのを避けるため)
(*9 つの hole について、右上を-1, 右中を-1.5, 右下を-2, などとするのは、
特定の defocus が特定の tilt angle になるのでイマイチかも)

□Hole/Eucentric の倍率を変えているので、

Image Shift Calibration を合わせなおす (これをやらないと Skip が連発します)

□他の事項については、通常と同様に撮影を行う。

19. 長期休暇時の対応

・電顕内部の温度を室温にする（真空は引いたまま）

グリッドやカセットの取り出し

- unload, undock (*Nanocab に液体窒素を入れる必要はない)
- 温度表示が緑に戻るまで待つ

Conditioning

- Autoloader>Temp Control の Option で、Conditioning both を選んで↔
- After conditioning は go to All Room Temp にする
- Dewer が 0%になるまで待つ
- 温度が室温になるまで待つ（**半日くらいかかります！**）

Falcon3, Ceta の冷却を OFF（*3-4 ヶ月に 1 回）

- Launcher の Tools から、Camera and detector の Falcon-3 service tool を選ぶ
- Basic Operation のタブの、Cooling controlled by TEM server のチェックを外す
- Cooling On から Off に変更（*自動で Off になります）
- Launcher の Tools から、Camera and detector, Ceta 16M Service Tool を選ぶ
- Basic Operation のタブの、Cooling controlled by TEM server のチェックを外す
- Cooling On から Off に変更（*自動で Off になります）

その他

- 電子銃および HT は ON のままにする
- 真空も引きっぱなしにする

・再立ち上げ時：電顕内部の温度を液体窒素温度にする

- 必要なら、Autoloader>Autoloader の Option の Initialize を押す
- Autoloader>Temp Control の Option の State から、
Temp State Go to: Conditioning both を選んで↵を押す。
Temp State Go to: All Nitrogen Temp & 8/7/2018, 7:00AM など↵。
すると、After Conditioning の表示が（日付、時刻）が変わる（over night）

Falcon3, Ceta の冷却を ON

- Launcher の Tools から、Camera and detector の Falcon service tool を選ぶ
- Tools から、Camera and detector, Falcon-3 Service Tool を選ぶ
- Basic Operation のタブの Cooling controlled by TEM server のチェックを入れる
- Cooling Off から On に自動で変更される（-25℃になるまで 10-20 分かかる）
- Launcher の Tools から、Camera and detector, Ceta 16M Service Tool を選ぶ
- Basic Operation のタブの Cooling controlled by TEM server のチェックを入れる
- Cooling Off から On に自動で変更される（-18℃になるまで 10-20 分かかる）

およそのアラインメント

- （*Column の Vacuum が 34 log 以下になるのを待つ。理想的には 1 log）
- Setup>Apertures の Option の Enable で Obj, SA が黄色になっていることを確認
- Column Valves を開いて、光があることを確認

- Align>Alignments の Option を押して、File から 200 を選んで、
Available にあるものを全て Selected に移動して、Apply を押す。
- Align>FEG Register の file から、200kV TEM を選んで Set を押す。

20. 電顕のシャットダウンと立ち上げ（計画停電の前や故障時）

・電顕のシャットダウン

グリッドやカセットの取り出し

- unload, undock (*Nanocab に液体窒素を入れる必要はない)
- 温度表示が緑に戻るまで待つ

Conditioning

- Autoloader>Temp Control の Option で、Conditioning both を選んで↵
- After conditioning は go to All Room Temp にする
- Dewer が 0%になるまで待つ
- 温度が室温になるまで待つ（**半日くらいかかります！**）

Gun の OFF

- EPU を落とす
- Setup>FEG Control の Option の power をクリックして、✓をクリック

温度が 0℃を越えたら...

- 操作 PC の Remote desk top で、Falcon server を shut down
- Software manager で電顕マーク右の□を右クリックして
Stop all を押してから、PC 落とす（操作 PC、Support PC 共に）
- 電源のメイン電源を落とす
- チラーをとめる（OFF ボタンを押す）
- Talos Arctica のブレーカーを落とす

・電顕の立ち上げ

電源関連

- ブレーカー, チラー, 電顕本体, 位相板ヒーターの電源を ON
- ガンの Back up 電源をしばらく OFF(真空が良すぎるとガンを Start できないので)
- Falcon server, 操作 PC, サポート PC を ON

TEM User Interface 関連

- Software Launcher から、TEM User Interface を立ち上げる。
(Hang up したら操作 PC を restart。立ち上がったら service 用に切り替え)
- Setup>Vacuum の Option の Control から To “All Vacuum”を押す *次ページに注あり
(*Tools>Vacuum Test か、TUI 右下>Vacuum Overview で残り時間がわかる)
- Autoloader>Autoloader の Option の Vacuum ON が押せるようになったら押す。
- Setup>FEG Control の Option の Power が押せるようになったら押す(1.5hr ほど)
- 2-3 分待つと Cold Start か Warm Start が押せるようになるのでいずれかを押す。
(Shutdown して、1-2 時間以内なら Warm start、それ以上なら Cold start)
そうすると、Setup>FEG Control の Extraction の値が徐々に上がっていく。
(Warm start は 25min くらいかかり、Cold start は 90min くらいかかる)
- ここで、ガンの Back up 電源を ON に戻す
- Autoloader>Autoloader の Option の Initialize を押す
- Autoloader>Temp Control の Option の State から、
Temp State Go to: Conditioning both を選んで↵を押す。
Temp State Go to: All Nitrogen Temp & 8/7/2018, 7:00AM などで↵。
すると、After Conditioning の表示が(日付、時刻)が変わる (over night)
- Setup>High Tension のボタンを、押せるようになったら押す。
まずは 80kV まで上げてから、段階的に 120, 160kV に上げる。
(Option の Emission がすぐ下がらないなど変なら、少し電圧を下げて待つ)
その後 Free high tension にチェックを入れて、10000V (=10kV) ずつ上げて、
190kV まで持っていく。さらにその後、1kV ずつ 200kV まで上げる。

およそのアラインメント

- (*Column の Vacuum が 34 log 以下になるのを待つ。理想的には 1 log)
- Setup>Apertures の Option の Enable で、Obj, SA を押して黄色にする。
 - Column Valves を開いて、光があることを確認

 - Align>Alignments の Option を押して、File から 200 を選んで、Available にあるものを全て Selected に移動して、Apply を押す。
 - Align>FEG Register の file から、200kV TEM を選んで Set を押す。

注 1 : 再立ち上げ時、To “All Vacuum”を押してもカラムの真空が良くならない場合

- おそらく、IGPco が動いてないので、Tools>Vacuum Test を開いて、Manual Mode を ON
- Vmco: open
TMP: ON
PVP: ON
Vbfpv: open
と設定する
- TMP が 100%になったら、Buffer cycle を押して、Manual Mode を OFF
- この状態で翌日まで放置（ガンの Backup 電源を OFF にしていたら ON に戻す）
- 翌日、ガンの Backup 電源を OFF して、To “All Vacuum”から再開

注 2 : 再立ち上げ時、TMP in error が出た (Vacuum Test で TMP が赤いはず)

- TEM User Interface を再起動
- Launcher から、Tools>Vacuum Test を開く (TMP が緑か小豆色になってるはず)
- Manual Mode を ON にして、
 - PVP ON
 - Vbfpv Open
 - Vmco Open
 - TMP ON
 と設定する
- TMP が 100% になったら、Manual Mode を OFF
 - そうすると、自動的に Vacuum State の表示が Cond. column になるはず。
 - この段階でカラムの真空を十分に引きたいので、2-3 時間放置。
- 待つ間に、Setup>FEG Control の Option で Power が押せるはずなので押す
 - Output が 3300V くらいになるはず (この段階だと、Current は 0.001uA)
 - 電子銃の Back up 電源を落としてあれば、Current が徐々に上がるはず
- IGP_a が動き始めたら Cold Start を押す (90 分待ち)
- 待っている間に、ガンの Back up 電源を ON に戻す
- カラムの真空が十分に下がったら、Vacuum Test の Evacuate all を押す
 - 自動的に IGP_{co} が ON になり、数分後に Vacuum State が All vacuum になるはず
- Autoloader>Autoloader の Option の Vacuum ON を押す
- Autoloader>Autoloader の Option の Initialize を押す
- Autoloader>Temp Control の Option の State から、
 - Temp State Go to: Conditioning both を選んで↵を押す。
 - Temp State Go to: All Nitrogen Temp & 8/7/2018, 7:00AM など↵。
 - すると、After Conditioning の表示が (日付、時刻) が変わる (over night)
- Setup>High Tension のボタンを押し、以降、p.40 の下から 5 行目の手順に戻る

21. Talos Arctica のレンズ/絞りの構成

Talos Arctica では、Lens, Apertures が、上から順に、以下のように配置されています。

Gun (+Gun lens)

C1 Lens

C2 Lens

Aperture

Mini-condenser Lens (*nano probe/micro probe の切り換え)

Obj Lens (*stage)

Aperture

Dif Lens

Int. Lens

SA Aperture

P1,2 Lens

V. 補遺

1. KEK の計算環境で Relion tutorial を行う際のパラメーター設定

(*Compute, Running の値は計算環境に依存します。所属施設の管理者にお尋ねください)

Import

```
I/O Movies/*.tiff, 2D micrograph movies
Run No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job001
```

Motion correction (=MotionCor2 を使用)

```
I/O Import/job001, 1, -1, 0.885, 200, 1.277, 0, Yes, Yes
Mot 300,5-5,1,1,Movies/gain.mrc(*blank@KEK),No,No,blank, No,/MotionCor2_1.1.0-Cuda91,0:1:2:3,blank
Run 4, 8, No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job002
```

CTF estimation (=Gctf を使用)

```
I/O MotionCorr/job002, Yes, 1.4 (*2.7@KEK), 200, 0.1, 0.885, 100
Ser 512, 30, 4, 5000, 50000, 500, No, 0-180-10
CTF No
Gct Yes, /gpfs/data/EM/software/Gctf_v1.06/Gctf-v1.06-sm_30_cu8.0_x86_64, No, Yes, blank, 0:1:2:3
Run 4, No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job003
```

Manual picking

```
I/O CtfFind/job003
Dis 160, 0.25, 3, 0, 0, 20, 0, -1, No, 1
Col No
Run No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job004 (500-1000 粒くらい拾う)
```

Particle extraction

```
I/O CtfFind/job003, ManualPick/job004, No, blank, No, No, 0-0-0, No, 1
Ext 256, Yes, Yes, 200, -1, -1, Yes, 64
Hel No
Run 12, No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job005
```

2D classification

```
I/O Extract/job005, blank
CTF Yes, No, No
Opt 50, 2, 25, No, 200, Yes, -1
Sam Yes, 6, 5, 1
Hel No
Com Yes, 16, No, blank, No, Yes, 0:1:2:3
Run 5, 4, No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job006 (データが少ない段階で mask のサイズを様子見)
```

Subset selection

```
I/O Class2D/job006, blank, blank, blank
Cla Yes, No, 1
Sub No
Dup No
Run No
→job007 (良い Class を選んで Save selected classes)
```

Auto-picking

```
I/O CtfFind/job003, -1, Select/job007, No, blank, C1, 30 deg, No
Lap (Please leave it as it is)
Ref 20, -1, 3.54, -1, 5, Yes, Yes, No
aut 0.6*, 80*, -1*, -999, Yes, No, 0, Yes, 0:1:2:3
Hel No
Run 4, No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job008 (拾われ方を確認。イマイチなら*のパラメーターを変更)
```

Particle extraction

```
I/O CtfFind/job003, AutoPick/job008, No, blank, No, No, 0-0-0, No, 1
Ext 256, Yes, Yes, 200, -1, -1, Yes, 64
Hel No
Run 12, No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job009 (7000 粒くらいになるはず)
```

2D classification

```
I/O Extract/job009, blank
CTF Yes, No, No
Opt 100, 2, 25, No, 200, Yes, -1
Sam Yes, 6, 5, 1
Hel No
Com Yes, 8, No, blank, No, Yes, 0:1:2:3
Run 5, 4, No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job010
```

Subset selection

```
I/O Class2D/job010, blank, blank, blank
Cla Yes, No, 1
Sub No
Dup No
Run No
→job011 (良い Class を選んで Save selected classes. Class2D はゴミ捨てのため複数回やっても良い)
```

3D initial model

```
I/O Select/job011, blank
CTF Yes, No, No
Opt 1, 200, Yes, C1, 15, 6, 2
SGD 25-100-25-10, 35-15, 100-500, -1
Com No, 16, No, Yes, blank, No, Yes, 0:1:2:3
Run 5, 4, No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job012 (Chimera で確認)
```

InitialModel/job012 に移動

```
relion_align_symmetry --i run_it150_class001.mrc --o run_it150_class001_alignD2.mrc --sym D2
relion_image_handler --i run_it150_class001_alignD2.mrc --o run_it150_class001_symD2.mrc --sym D2
```

Import

```
I/O InitialModel/job012/run_it150_class001_symD2.mrc, 3D reference
Run No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job013
```

```
job012:Display:out:run_it150_class001.mrc と
job013:Display:out:run_it150_class001_symD2.mrc を比較。対称性が導入されたことを確認
```

3D classification

```
I/O Select/job011, blank, Import/job013, blank
Ref Yes, 50, C1
CTF Yes, Yes, No, No
Opt 4, 4, 25, No, 200, Yes, -1
Sam Yes, 7.5, 5, 1, No, 5
Hel No
Com No, 4, No, Yes, blank, No, Yes, 0:1:2:3
Run 5, 4, No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job014
```

結果の確認

metadata で分解能と粒子数を調べる。
Chimera で形状を確認。
どれが一番良い Class か判断。

Subset selection

```
I/O Class3D/job014, blank, blank, blank
Cla Yes, No, 1 (*Yes,Yes,200@KEK)
Sub No
Dup No
Run No
→job015 (良い Class を選んで Save selected classes)
```

Particle Extraction

```
I/O CtfFind/job003, blank, Yes, Select/job015, No, No, 0-0-0, No, 1
Ext 360, Yes, Yes, 200, -1, -1, Yes, 256
Hel No
Run 12, No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job016 (おそらく 5000 粒くらい)
```

Class3D/job014 に移動

```
relion_image_handler --i run_it025_class###.mrc --angpix 3.54 --rescale_angpix 1.244 --o
run_it025_class###_box256.mrc --new_box 256
```

Import

```
I/O Class3D/job014/run_it025_class###_box256.mrc, 3D reference
Run No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job017
```

3D auto-refine

```
I/O Extract/job016, blank, Import/job017, blank
Ref No, 50, D2
CTF Yes, Yes, No, No
Opt 200, Yes, No
Aut 7.5, 5, 1, 1.8
Hel No
Com No, 4, No, Yes, blank, No, Yes, 0:1:2:3
Run 5, 4, No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job018
```

結果の確認

Chimera で確認。閾値が th=0.0##であることを確認。

Mask creating

```
I/O Refine3D/job018
Mas 15, 1.244, 0.0##, 0, 6 (*15,30@KEK)
Hel No
Run 12, No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job019
```

Post-processing

```
I/O Refine3D/job018, MaskCreate/job019, 1.244
Sha mtf_k2_300kV.star (*blank@KEK), Yes, 10, No, -1000
Fil No
Run No, openmpi, qsub, /public/EM/RELION/relion/bin/relion_qsub.csh, 1, blank
→job020
```

Local resolution

```
I/O Refine3D/job018, 1.244
Res No
Rel Yes, ### (*PostProcess の apply b-factor of の値を記入), blank
Run 5, 4, No
→job021
```


2. EPU-D を使わずに microED の測定を行う際の手順 (暫定版)

(*本項目は暫定版であることを十分に理解した上で、かつ、必ず施設責任者・装置責任者の許可を得てから実験を開始して下さい!!!)

・カメラ長の確認

- ☐ Cross grating grid (2160, 1/mm, 3.05mm)を電顕に入れる
(*常温保存 Grid は、Casette の 12 から順に入れる。NanoCab の液体窒素量も少なめにして、Grid に液体窒素の泡が直撃しないように注意する)
- ☐ 温度表示が緑に戻るまで待つ
- ☐ 金のある領域に移動
- ☐ Hole/Eucentric の倍率で set して Auto Eucentric by beam tilt で高さ合わせ
- ☐ Data Acquisition で set。蛍光板を下ろす。
- ☐ Diffraction mode にして、Beam stopper を入れて、カメラを Ceta にする
- ☐ AUtoloader>CCD/TV Camera>integration time = 0.1 sec or 0.05 sec
- ☐ 例えば、D=330, 420, 530, 670, 850, 1050mm などの画像を Acquire し、
右クリック>Export data>PC TIFF(16Bits)w/scale maker(full res)で保存
- ☐ カメラ長を計算(*例えば D=530mm だと KEK の Talos Arctica では 761mm に相当)

・microED 用の Alignment (*Gun lens=8, Extractor=3800 の設定)

およそのアラインメント

- ☐ Setup>Apertures の Option の Options で、一番上の check box を外す
- ☐ Grid なしの状態で行う (もしくは Grid に穴のあいたところで行う)
- ☐ Preparation タブ>Import で **E:/Preparation/200117_microED.sxml** を選択
- ☐ **Data Acquisition の設定を Spot size=11 から 9 に変更 (*11 だと暗すぎるので)**
- ☐ Column Valves を開く (蛍光板を下ろして光が来ているかを確認)
- ☐ Align>Alignment の Option を押して、File から **200_GL8_ex4000** を選び、
Available にあるものを全て Selected に移動して、Apply を押す。
- ☐ Align>FEG register の file から、**200kV_GL8_Ex4000** を選んで Set を押す。

C2 絞りの中心合わせ

- ☐ Grid なしの状態で行う（もしくは Grid に穴のあいたところで行う）
- ☐ EPU の Preparation タブで、Grid Square にして set
- ☐ **操作パネルの Eucentric focus ボタンを押す（*700x で Obj lens=6.0968）**
- ☐ EPU の Preparation タブで、Data Acquisition にして set
- ☐ **操作パネルの Eucentric focus ボタンを押す（*92k で Obj lens=86.5740）**
- ☐ C2=50, Obj=none になっていることを確認。蛍光板を下ろし、倍率を 17500 倍に。

1 回目

- ☐ Intensity ダイアルを左に回してビームを絞る
- ☐ Direct Alignment から Beam shift を選び、Multi function ダイアルで光を中央に移動
- ☐ Intensity 右に回して光を画面いっぱいを広げる
- ☐ C2 の横の Adjust を押して、Multi function ダイアルで、
光の円が画面の四辺に接するように移動する
- ☐ C2 の横の Adjust をもう一度押す

2 回目

- ☐ もう一度ビームを絞って、Multi function ダイアルで光を中央に移動
- ☐ Intensity 右に回して光を画面いっぱいを広げる
- ☐ C2 の横の Adjust を押して、Multi function ダイアルで、
光の円が画面の四辺に接するように移動する
- ☐ C2 の横の Adjust をもう一度押す
(*ビームを絞った時も広げた時も中央にくるよう、以上を何回か繰り返す)
- ☐ Direct Alignment の Beam shift を Done する(*光の輪がほぼ同心円状に広がれば OK)
- ☐ C2=150 については確認のみで OK (Beam shift で光を動かさない)

ピボットポイントの調整

- ☐ Grid なしの状態で行う（もしくは Grid に穴のあいたところで行う）
- ☐ EPU の Preparation タブで、Data Acquisition にして Set
- ☐ C2=50, Obj=none になっていることを確認。蛍光板を下ろす。
- ☐ 倍率を 28000 倍にして、Intensity で光を絞る
- ☐ Direct Alignment から、nP Beamtilt pp X を選ぶ
- ☐ Multi Function ダイアル X (と Y) で、点滅する 2 つの光が重なるように微調整する
- ☐ Direct Alignment から、nP Beamtilt pp Y を選んで同様に合わせる
- ☐ Done を押す

Rotation Center

- ☐ Autoloader を使って、何かグリッドを入れる
 - ☐ Column Valve を Open して、EPU の Preparation タブで Atlas の Preview をとる
 - ☐ Move stage here で、目立つゴミのあるところへ移動
 - ☐ EPU の Preparation タブで Grid Square の Preview をとる
 - ☐ Move stage here で、目立つゴミのあるところへ移動
 - ☐ Search>Stage の option で z=180um に合わせる
 - ☐ EPU の Preparation タブで Hole/Eucentric の Preview をとる
 - ☐ Move stage here で、目立つゴミのある近くへ移動
 - ☐ EPU の Auto Functions タブで、Hole/Eucentric にして Auto Eucentric by stage tilt
-
- ☐ 蛍光板を下ろして、倍率を 8500 倍から倍率 57000 倍にする。C2=150, Obj=none。
 - ☐ このままだと暗くて何も見えないので Intensity を左に回す
 - ☐ 目立つゴミを探して画面の中心に持ってくる
 - ☐ Direct Alignment から、Rotation Center を選ぶ。
- Multi Function ダイアルで、ゴミが上下左右に動かなくなるように微調整する
- （*この後、AutoCTF でコマ収差を除くので、ある程度あっていれば良いそうです）
- ☐ Done を押す

位相板への焦点合わせ (Spot size=9)

- ☐ 蛍光板を上げる
 - ☐ EPU の EPU タブの Square selection など、やぶけて穴が空いているところに移動
 - ☐ 蛍光板を下げる
 - ☐ Preparation タブで、Data Acquisition で Set
 - ☐ 倍率を 13500 倍のままで、C2: 150 (視野を広げる)、**位相板 (PhP4) を入れる**
(*位相板の影が出るので PhP4 の position 21-31, 39-51, 58-71 を使うのが良い)

 - ☐ TUI の表示モードを Linear にする (そのほうが見やすい)
 - ☐ ヒストグラムのところではピークのみを選んで、もやもやが見えるようにする
 - ☐ Intensity を Fine にして、左右に回して focus を合わせる
(*Intensity を回すと、もやもや→縦シマ→白→横シマ→もやもや、などと変わるので、
左右に行ったり来たりして、シマシマの向きが 90 度変わるところを探す)
 - ☐ Stigmator を Condensor にして、Multifunction X,Y で後焦点面に焦点を合わせる
(*それなりにコツがいるが、シマシマを伸ばす感じでやると上手くいく。
シマシマが見えるのは、ビームが楕円になっているということ)
終わったら、像が消えるところで Intensity ダイアルを止めて (=Just focus)
None を押す (*これ以降、Intensity ダイアルは触らないこと)
 - ☐ Phase plate は、Setup>Apertures の Option>Phase Plate を選んで、Next を押す
 - ☐ TUI の表示モードを Natural に戻す
 - ☐ **倍率 13500 倍、C2 絞りを 50、Obj 絞りを none にする**
 - ☐ EPU の Preparation タブで、
 - Data Acquisition にして Get
 - Autofocus にして Get
 - Drift Measurement にして Get
- *参考 : 平行照射になる C2 Lens の目安の値 (%) Spot 11: 36.3%, **9: 36.94%**,
Spot 8: 37.8%, 7: 38.5%, 6: 39.55%, 5: 40.7%, 4: 42.0%

対物絞りの中心合わせ

- ☐ 位相板への焦点合わせの後に行う (= 平行照射の状態で行う)
- ☐ 蛍光板を上げて、ゴミのあるところへ移動 (C2: 50, Obj: none)
- ☐ EPU の Auto Functions タブで、Hole/Eucentric にして Auto Eucentric by stage tilt

☐ EPU の Preparation タブで Hole/Eucentric にして撮影。ゴミのないカーボン面へ移動

☐ EPU の Preparation タブで、Data Acquisition にして set

☐ C2=50, Obj=none

☐ **必ず蛍光板を下ろす**

(* 蛍光板を下ろさずに Diffraction ボタンを押すとカメラが壊れることがあります)

☐ Diffraction のボタンを押す (EPU でエラーが出るが、無視して次に進む)

☐ D=530mm くらいになっていることを確認

☐ **ここで、Focus ノブを回して中央の輝点を極小にしておく**

☐ Obj=100

☐ TUI は HDR モードにする

* (ほぼ合っているはずなので、一応確認はするが、以下 3 点はやらないほうが無難)

(☐ Objective の横の Adjust を押す)

(☐ Multi Function ダイヤルで、明るい光の中心とぼやとした光の中心が合うようにする)

(☐ Objective の横の Adjust をもう一度押す)

☐ Diffraction ボタンをもう一度押して終了 (EPU のエラーに対しては Yes を押す)

AutoCTF

- ☐ ゴミのあまりないカーボン膜上に移動 (C2: 50, Obj: none)
- ☐ Hole/Eucentric の倍率で高さ合わせ (*対物絞りの中心合わせでやってあれば不要)
- ☐ Reset Defocus (=R2 を押す)

- ☐ EPU の Preparation タブで、Data Acquisition で Set (**C2: 50, Obj: none**)
- ☐ 倍率 45000 倍にする
- ☐ 光がずれていたら、Beam Shift で中央に
- ☐ もう一度、Data Acquisition で Set して、倍率 45000 倍にする
- ☐ 蛍光板を上げる
- ☐ カメラを Falcon にする (Autoloader>CCD/TV Camera で BM-Falcon にして Insert)
- ☐ Microscope Software Launcher の Tools から Sherpa を立ち上げる (少し時間かかる)
(*Auto Functions タブ経由でも可能ですが、失敗してもエラーが出ない点がイマイチ)

- ☐ **Electron counting のボックスにチェックを入れる**
(Exp.: **12**, Binning: **1**, Readout: Full, Auto-focus-to: チェックして-2.0)
(**Focus ダイアルを回して Defocus を-3um くらいかける**)
- ☐ Objective Stigmatism の Measure を押す (*グリッドに跡がついてたら少し移動)
- ☐ トーンリングが拾えたら、Correct を押す
(対物レンズの非点収差をとってくれる。光があまり暗いと拾ってくれない)
(途中で Stop しないこと。Stop すると途中の変な状態で止まってしまう)

- ☐ 右下に Passed と出たら終了。Coma は不要。

位相板への焦点合わせ (Spot size=11)

□Preparation タブの Data Acquisition の設定を Spot size=11 に戻す

- 蛍光板を上げる
 - EPU の EPU タブの Square selection など、やぶけて穴が空いているところに移動
 - 蛍光板を下げる
 - Preparation タブで、Data Acquisition で Set
 - 倍率を 13500 倍のままで、C2: 150 (視野を広げる)、**位相板 (PhP4) を入れる**
(*位相板の影が出るので PhP4 の position 21-31, 39-51, 58-71 を使うのが良い)
 - TUI の表示モードを Linear に(**TUI 左上の Camera>Settings>Exp.time=200 に**)
 - ヒストグラムところでピークのみを選んで、もやもやが見えるようにする
 - Intensity を Fine にして、左右に回して focus を合わせる
(*Intensity を回すと、もやもや→縦シマ→白→横シマ→もやもや、などと変わるので、
左右に行ったり来たりして、シマシマの向きが 90 度変わるところを探す)
 - Stigmator を Condensor にして、Multifunction X,Y で後焦点面に焦点を合わせる
(*それなりにコツがいるが、シマシマを伸ばす感じでやると上手くいく。
シマシマが見えるのは、ビームが楕円になっているということ)
終わったら、像が消えるところで Intensity ダイアルを止めて (=Just focus)
None を押す (***これ以降、Intensity ダイアルは触らないこと**)
 - Phase plate は、Setup>Apertures の Option>Phase Plate を選んで、Next を押す
 - TUI の表示モードを Natural に戻す
 - 倍率 13500 倍、C2 絞りを 50、Obj 絞りを none にする**
 - EPU の Preparation タブで、
 - Data Acquisition にして Get
 - Autofocus にして Get
 - Drift Measurement にして Get
- *TUI 左上の Camera>Settings>Exp.time は自動で 100 に戻る**

*参考：平行照射になる C2 Lens の目安の値 (%) **Spot 11: 36.3%**, 9: 36.94%,
Spot 8: 37.8%, 7: 38.5%, 6: 39.55%, 5: 40.7%, 4: 42.0%

EPU における dose, fraction の設定

- ☐ Grid に穴のあいたところに移動
- ☐ EPU の Preparation タブの Presets を Data Acquisition にして Set
- ☐ **C2: 50, Obj: none**
- ☐ Exposure Settings を、Linear, Manual, No, Dose= ~ 50 , Fractions=12 などとする
- ☐ Dose Rate のところの Measure ボタンを押す
- ☐ **Dose rate が $0.01-0.02 \text{ e}/\text{\AA}^2/\text{s}$ くらいになるはず**
- ☐ EPU の Preparation タブで、
 - Data Acquisition にして Get
 - Autofocus にして Get
 - Drift Measurement にして Get

・測定前の準備

- ☐ Atlas acquisition → EPU session setup
- ☐ Square Selection で目的の Square を Add して、Hole Selection で Acquire
- ☐ AutoFunction, Hole/Eucentric, Auto Eucentric by stage tilt の後、再び Acquire

- ☐ 結晶のあるところを右クリックで Add して、Move stage to here
- ☐ Preparation の Data acquisition で set (*13500x)
- ☐ C2=150、TUI の Search>Stage>Option で 0° にしてから、蛍光板を下ろす
- ☐ 高さが正しければ結晶や Hole が見にくいはず。
 全く見えない時は Focus ノブを回して defocus をかける。
 (*結晶があまりにもはっきり見える場合は結晶から少し離れたところで再度高さ合わせ)
- ☐ 結晶を画面中心へと移動させて、TUI の Search>Stage>Option で 10° tilt
- ☐ 結晶が中心から少しずれるので、操作パネル右の z ボタンで結晶を中心に戻す
- ☐ Eucentric focus を押して、C2=50, Obj=none

- ☐ Diffraction mode に変更 (カメラ長は D=530mm (低分子), 2.2m (蛋白) など)
- ☐ 必要なら、Focus ノブを回して中心の光をできるだけ小さくする
- ☐ Beam stopper を出す (大/小あるので小さいほうを選ぶ)
- ☐ Direct alignments > Diffraction alignment で、中心の強い光を隠す
- ☐ 蛍光板を上げる

・等速 tilt による回折データ測定

- ☐ Velox を起動 (*測定画面と画像表示画面の、Window が 2 つ出ます)
 - (*Dose is too high のメッセージが出るが、
CCD/TV Camera で BM-Ceta を選んで Insert すると消えます)
- ☐ **Edit>Preferences で、保存先を決める**
- ☐ Velox の測定画面の上の方から Ceta を選ぶ
- ☐ Velox のカメラマークで 10°と 0°のスナップショット撮影 (移動は TUI の Stage²で)
 - 条件の例 : Acquire, 2048x2048, 5s, 1frame
- ☐ Velox のビデオマークで測定条件を指定
 - 条件の例 : Series, 2048x2048, 5s, 1frame, 40 frames
 - (*-0.1deg/sec で+10°から-10°に移動して 5 秒露光だと 40 frames なので)
- ☐ 等速 tilt の条件を指定
 - Service 用 Launcher の工具マークの Start ボタンを押す
 - TadUI の Window が出てくるので、Compustage>Monitor>Control MkI
 - 2 つ Window が出てくるので、Basic タグの Jog ボタンを押す
 - TUI の Stage²で+10°に設定
 - Jog window 中の、A= -0.1deg/sec にしてチェック入れて、total=200sec
 - (*この設定だと、+10°から-10°まで等速 tilt する)
- ☐ Velox のビデオマークを押して測定開始
- ☐ 1 枚目が表示されたら、Jog window の Start を押して等速 tilt を開始
- ☐ 終わったら Diffraction mode を解除。Stage²で 0°に戻して、次の結晶に移動

同じ Square の結晶を撮影する場合は以降を繰り返す

- ☐ 結晶のあるところを右クリックして Add して、Move stage to here
- ☐ Preparation の Data acquisition で set (*13500x)
- ☐ C2=150、TUI の Search>Stage>Option で 0°にしてから、蛍光板を下ろす
- ☐ 高さが正しければ結晶や Hole が見にくいはず。
全く見えない時は Focus ノブを回して defocus をかける。
(*結晶があまりにもはっきり見える場合は結晶から少し離れたところで再度高さ合わせ)
- ☐ 結晶を画面中心へと移動させて、TUI の Search>Stage>Option で 10° tilt
- ☐ 結晶が中心から少しずれるので、操作パネル右の z ボタンで結晶を中心に戻す
- ☐ Eucentric focus を押して、C2=50, Obj=none
- ☐ Diffraction mode に変更 (カメラ長は D=530mm (低分子), 2.2m (蛋白) など)
- ☐ 一瞬輝点が見えたら蛍光板を上げる

・等速 tilt による回折データ測定

- ☐ Velox のカメラマークで 10°と 0°のスナップショット撮影 (TUI の Stage²で移動)
条件の例 : Acquire, 2048x2048, 5s, 1frame
- ☐ Velox のビデオマークで測定条件を指定
条件の例 : Series, 2048x2048, 5s, 1frame, 40 frames
- ☐ 等速 tilt の条件を指定
 - TadUI>MkI>Basic タグの Jog ボタンを押す
 - TUI の Stage²で+10°に設定
 - Jog window 中の、A= -0.1deg/sec にしてチェック入れて、total=200sec
- ☐ Velox のビデオマークを押して測定開始
- ☐ 1 枚目が表示されたら、Jog window の Start を押して等速 tilt を開始
- ☐ 終わったら Diffraction mode を解除。Stage²で 0°に戻して、次の結晶に移動